TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS



PCT



RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire Demande internationale No. PCT/EP 03/06375				POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)		
				1	ional (jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année)
				17.06.2003		21.06.2002
	sificati		ernationale des brevets (CII	3) ou à la fois classificatio	on nationale et CIB	
Dépo ASU		S.A.	et al.			
1.	Le p	réser rnatio	nt rapport d'examen préli nal, est transmis au dép	iminaire international, o osant conformément à	établi par l'administarati l'article 36.	on chargée de l'examen préliminaire
2.	Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.					
	II est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).					
Ces annexes comprennent 4 feuilles.						
3.	Le p	réser ⊠		dications et les pages	correspondantes relativ	ves aux points suivants :
	! 		Base de l'opinion Priorité			
	111			n d'opinion quant à la s n industrielle	nouveauté, l'activité inv	entive et la
	IV		Absence d'unité de l'in			
	٧	\boxtimes	Déclaration motivée se d'application industriell	elon la règle 66.2(a)(ii) le; citations et explicati	quant à la nouveauté, l ons à l'appui de cette d	'activité inventive et la possibilité éclaration
	VI		Certains documents ci	tés	•	
	VII		Irrégularités dans la de	emande internationale		
	VIII		Observations relatives	à la demande internat	ionale	
Date of			tion de la demande d'exam	en préliminaire	Date d'achèvement du p	présent rapport
17.12.2003					15.10.2004	
		intern	ostale de l'adminstration ch ational	argée de l'examen	Fonctionnaire autorisé	ablactura Painosa op.
Office européen des brevets D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d					Noirard, P	, se (a mar)
Fax: +49 89 2399 - 4465					N° de téléphone +49 89	2399-2420

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n°

PCT/EP 03/06375

I.	Base	du	rap	port
----	------	----	-----	------

1. En ce qui concerne les éléments de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications (règles 70.16 et 70.17)):

	Des	scription, Pages	
	1-1	4	telles qu'initialement déposées
	Rev	vendications, No.	
	1-1	6	reçue(s) le 19.05.2004 avec lettre du 07.05.2004
	Des	ssins, Feuilles	
	1/5-	5/5	telles qu'initialement déposées
2.	ou l	ce qui concerne la la: lui ont été remis dans traire donnée sous ce	ngue, tous les éléments indiqués ci-dessus étaient à la disposition de l'administration la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, sauf indication e point.
	Ces	s éléments étaient à la	a disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue suivante: ,qui est:
		la langue d'une trade	action remise aux fins de la recherche internationale (selon la règle 23.1(b)).
		la langue de publica	tion de la demande internationale (selon la règle 48.3(b)).
		la langue de la tradu 55.3).	ction remise aux fins de l'examen préliminaire internationale (selon la règle 55.2 ou
3.	inte	ce qui concerne les s rnationale (le cas éch uences :	équences de nucléotides ou d'acide aminésdivulguées dans la demande éant), l'examen préliminaire internationale a été effectué sur la base du listage des
		contenu dans la dem	nande internationale, sous forme écrite.
		déposé avec la dem	ande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.
		remis ultérieurement	à l'administration, sous forme écrite.
		remis ultérieurement	à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur.
		La déclaration, selor de la divulgation faite	laquelle le listage des séquences par écrit et fourni ultérieurement ne va pas au-delà e dans la demande telle que déposée, a été fournie.
		La déclaration, selor à celles du listages d	laquelle les informations enregistrées sous déchiffrable par ordinateur sont identiques les séquences Présenté par écrit, a été fournie.
4.	Les	modifications ont ent	raîné l'annulation :
		de la description,	pages:
		des revendications,	nos:
		des dessins,	feuilles:

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n°

PCT/EP 03/06375

5. 🗆	
	comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle
	70.2(c)):

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1 et annexée au présent rapport.)

- 6. Observations complémentaires, le cas échéant :
- V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- 1. Déclaration

Nouveauté Oui: Revendications 1-16

Non: Revendications Activité inventive

Revendications Oui: 1-16

Non: Revendications Possibilité d'application industrielle Oui: Revendications 1-16

Non: Revendications

2. Citations et explications

voir feuille séparée

Concernant le point V

Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

- 1. Il est fait référence aux documents suivants :
 - D2: US 2001/050748 A1 (LEE SANG SEOK) 13 décembre 2001 (2001-12-13)
 - D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 309 (P-1235), 7 août 1991 (1991-08-07) -& JP 03 110518 A (STANLEY ELECTRIC CO LTD), 10 mai 1991
- 2. La demande ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 6. PCT pour les raisons suivantes:
- Les revendications 1 et 4 ont été rédigées en tant que revendications indépendantes séparées. Par conséquent, la présente demande n'est pas concise car il semble possible de rendre la revendication 4 dépendante de la première revendication par l'ajout d'une étape consistant à structurer une deuxième cloison formant un canal de remplissage.
- 2.2 Au vu du problème objectif résolu par la présente demande (cf §3.3, ci-dessous), il apparaît essentiel de mentionner explicitement dans la(les) revendication(s) indépendante(s) que la matière de scellement est introduite après réunion des substrats. Il a donc été considéré pour l'établissement du présent rapport que la première revendication comprend l'étape suivante:
 - "- introduire une matière de scellement susceptible de s'écouler dans l'interstice (28) délimité par lesdits substrats réunis (4,6) et la face latérale "....;
 - et que la revendication indépendante 4 comprend l'étape suivante:
 - "- introduire une matière de scellement susceptible de s'écouler entre les deux substrats réunis et dans le canal de remplissage (22) jusqu'à ce que"...

Remarque: bien que la revendication 4 telle que soumise par le demandeur dans sa lettre du 19/05/04 semble satisfaire aux critères de l'Article 33(1), PCT, les suppositions faites ci dessus (i.e. considérer explicitement l'introduction de matière après réunion des substrats) forment le lien permettant d'assurer l'unité de l'invention, de sorte qu'il est important de considérer les deux amendements pour que l'invention soit unitaire

2.3 Le terme "grande" utilisé dans la revendications 2,4 est vague et laisse un doute quant à la signification de la caractéristique technique à laquelle il se réfère.

- 3.1 Le document D2, qui est considéré comme étant l'état de la technique le plus proche de l'objet des revendications indépendantes décrit (Fig. 3A-3E) : un procédé de fabrication d'une cellule d'affichage à cristaux liquides (cf. Title) comprenant un premier substrat avant (1), un second substrat arrière (2) comportant des électrodes (cf. §20) et réunis par un cadre de scellement (8+3) comprenant une cloison structurée (8) et un joint de scellement (3) pour le confinement étanche des cristaux liquides (5). Le procédé comporte en outre les étapes consistant à:
 - * structurer les électrodes sur les substrats (implicite dans D2);
 - * structurer sur un substrat une cloison destinée à séparer les cristaux liquides de la matière de scellement (cf. Fig. 3A-3E);
 - * "introduire" une matière de scellement (3, Cf. Figs. 3A-3E);
 - * réunir les substrats (Fig. 3C);
 - * solidifier la matière de scellement (Fig. 3D, §21).
- 3.2 Le document D2 ne décrit ni l'existence de plots de contacts permettant d'établir les liaisons électrique entre la cellule et le circuit de commande, ni que la matière formant le joint de scellement est introduite après réunion des substrats. Dans D2, le joint (3,18) est déposé sur le substrat <u>avant</u> réunion des substrats (cf. Fig. 3A,4C).
- 3.3 Autant l'art antérieur suggère l'ajout de plots de contacts (e.g. D2), autant aucun des documents disponibles ne suggère d'introduire la matière de scellement <u>après</u> la réunion des substrats.
 - L'établissement d'un ordre chronologique pour cette introduction permet de résoudre le problème du contrôle précis de la quantité de matière de scellement déposée et permet aussi d'augmenter l'intégrité des cristaux liquides vis à vis de la matière de scellement. En effet, lorsque la matière de scellement est déposée après la réunion des substrats, d'une part la quantité de matière peut être contrôlée avec précision, d'autre part celle ci ne peut définitivement pas pénétrer dans le volume actif du fait de la cloison en place.
- 3.4 L'objet des revendications 1,4 est donc nouveau (article 33(2) PCT) et est considéré comme impliquant une activité inventive (article 33(3) PCT).
 Les revendications 2-3,5-16 dépendent des revendications 1,4, elles satisfont donc également, en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive.
- 4. L'application industrielle concernant l'ensemble des revendications est clairement démontrée à travers l'exposé de la demande (article 33(3), PCT).

20

30

REVENDICATIONS

- 1. Procédé de fabrication d'une cellule électro-optique, en particulier une cellule à cristaux liquides (2), ou une cellule photovoltaïque électrochimique comprenant :
- au moins un premier substrat avant (4) transparent dont la surface supérieure constitue la face avant de la cellule (2);
- au moins un second substrat arrière (6) qui peut être également transparent ou non et dont la surface inférieure constitue la face arrière de ladite cellule (2);
- les substrats (4, 6) étant réunis par un cadre de scellement qui délimite un volume (8) pour le confinement d'une matière sensible dont les propriétés physiques, notamment optiques, ou électriques sont susceptibles de changer;
- les substrats (4, 6) comportant sur leurs faces en regard au moins une électrode (14, 16), ces électrodes (14, 16) étant destinées à être reliées à un circuit électrique d'alimentation ou de commande, et
- les électrodes (14, 16) de la cellule (2) se prolongeant sensiblement jusqu'aux bords de la cellule pour constituer des moyens de connexion (18) permettant d'établir la liaison électrique entre ladite cellule (2) et le circuit d'alimentation ou de commande,

ce procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à :

- structurer sur chacun des substrats (4, 6) les électrodes (14, 16) correspondantes;
- déposer sur chaque électrode (14, 16), dans la région où ces électrodes affleureront les bords de la cellule, un plot de contact (20) réalisé en une matière électriquement conductrice;
- structurer sur l'un des substrats (4, 6) au moins une cloison (12) qui délimite 25 par sa face latérale interne le volume (8) pour le confinement de la matière sensible, cette cloison (12) s'étendant en retrait par rapport aux bords de la cellule, de façon à dégager les contacts de connexion (18), et étant donc traversée par les électrodes (14, 16);
 - réunir le second substrat (4) avec le premier substrat (6);
 - introduire une matière de scellement susceptible de s'écouler dans l'interstice (28) délimité par lesdits substrats (4, 6) et la face latérale externe de la cloison (12) jusqu'à ce qu'au moins une partie de cet interstice soit occupée par la matière de scellement, et
- solidifier la matière de scellement afin que celle-ci forme le cadre de
 scellement de la cellule (2) ainsi obtenue.

10

15

20

25

30

- 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre l'étape consistant à couper la cellule (2) de telle sorte qu'elle présente une tranche sensiblement plane avec des plages de contact latéral présentant une grande surface active.
- 3. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que l'on fait pénétrer la matière de scellement dans l'interstice (28) par capillarité.
- 4. Procédé de fabrication d'au moins une cellule électro-optique, en particulier une cellule à cristaux liquides (2), ou une cellule photovoltaïque électrochimique comprenant :
- au moins un premier substrat avant (4) transparent dont la surface supérieure constitue la face avant de la cellule (2);
- au moins un second substrat arrière (6) qui peut être également transparent ou non et dont la surface inférieure constitue la face arrière de ladite cellule (2);
- les substrats (4, 6) étant réunis par un cadre de scellement qui délimite un volume (8) pour le confinement d'une matière sensible dont les propriétés physiques, notamment optiques, ou électriques sont susceptibles de changer;
- les substrats (4, 6) comportant sur leurs faces en regard au moins une électrode (14, 16), ces électrodes (14, 16) étant destinées à être reliées à un circuit électrique d'alimentation ou de commande, et
- les électrodes (14, 16) de la cellule (2) se prolongeant sensiblement jusqu'aux bords de la cellule pour constituer des moyens de connexion (18) permettant d'établir la liaison électrique entre ladite cellule (2) et le circuit d'alimentation ou de commande,

ce procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à :

- structurer sur chacun des substrats (4, 6) les électrodes (14, 16) correspondantes;
- déposer sur chaque électrode (14, 16), dans la région où ces électrodes affleureront les bords de la cellule, un plot de contact (20) réalisé en une matière électriquement conductrice;
- structurer sur l'un des substrats (4, 6) au moins un canal de remplissage (22) délimité par deux cloisons (10, 12) qui s'étendent à distance l'une de l'autre et entre lesquelles sont disposés les plots de contact (20);
 - réunir le second substrat (6) avec le premier substrat (4);
- introduire une matière de scellement susceptible de s'écouler dans le canal de remplissage (22) jusqu'à ce que tout le volume dudit canal de remplissage (22) soit occupé;

10

15

20

25

30

- solidifier la matière de scellement afin que celle-ci forme le cadre de scellement, et
- couper la cellule (2) afin que celle-ci présente une tranche sensiblement plane avec des plages de contact latéral présentant une grande surface active.
- 5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'on réalise un lot de cellules (2) comportant deux plaques (36, 38) communes à toutes les cellules et un réseau de cloisons (10, 12) délimitant, pour chaque cellule, un volume (8) pour le confinement de la matière sensible de même que des canaux de remplissage (22) qui sont destinés à être remplis avec une matière de scellement pour lier les deux plaques (36, 38) et former les cadres de scellement desdites cellules.
- 6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'une première pluralité de trous (26) pour le remplissage des volumes (8) avec la matière sensible, et une seconde pluralité de trous (24) pour l'amenée de la matière de scellement sont pratiqués dans l'une des plaques (36) ou (38).
- 7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, caractérisé en ce que l'on fait pénétrer la matière de scellement dans le canal de remplissage (22) par capillarité.
- 8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à :
 - faire le vide dans le canal de remplissage (22);
- faire pénétrer la matière de scellement dans ledit canal de remplissage (22), et
- rétablir la pression à l'extérieur de la cellule (2) de sorte que, sous l'effet de la différence de pression entre le canal de remplissage (22) dans lequel règne le vide et la pression environnante, la matière de scellement est chassée jusqu'au fond du canal de remplissage.
- 9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que l'on dépose sur l'un des substrats (6) une couche d'un matériau photorésist que l'on va ensuite structurer par des techniques de photogravure pour lui donner la forme d'une ou de plusieurs cloisons (10, 12).
- 10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que la couche de photorésist est structurée de façon à former, non seulement la ou les cloisons (10, 12), mais également des structures d'espacement destinées à maintenir un écartement constant entre les deux substrats (4, 6) de la cellule (2).
- 11. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que la matière de scellement est choisie dans le groupe formé par les résines pouvant être polymérisées par sensibilisation à l'aide d'une lumière ou par chauffage

en élevant la température du milieu ambiant, par les résines thermoplastiques, par les colles cyanoacrylates et par les colles bicomposants dont les composants durcissent avec le temps ou sous l'effet d'une augmentation de température lorsqu'ils sont mis en présence l'un de l'autre.

- 12. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que les plots de contact (20) sont formés par croissance galvanique.
 - 13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en ce que les plots de contact (20) sont réalisés en or.
- 14. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé
 10 en ce que les plots de contact sont réalisés par impression sélective.
 - 15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en ce qu l'on emploie une résine chargée de particules conductricès.
 - 16. Procédé selon la revendication 15, caractérisé en ce que la résine est une colle époxy.